



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201591476 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 29

(21) 申请号 200920266651. X

(22) 申请日 2009. 12. 10

(73) 专利权人 瀛丽企业股份有限公司

地址 中国台湾台南市新义路 25 号

(72) 发明人 吴明峰

(74) 专利代理机构 北京中原华和知识产权代理

有限责任公司 11019

代理人 寿宁 张华辉

(51) Int. Cl.

A47J 42/38 (2006. 01)

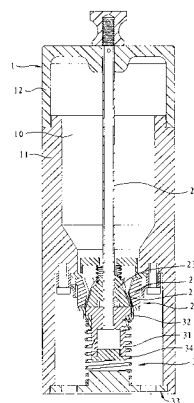
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 4 页

(54) 实用新型名称

胡椒研磨器

(57) 摘要

本实用新型是有关于一种胡椒研磨器,包含:一容装单元、一研磨单元,以及一启闭单元。该启闭单元包括一个可转动地设置的转动件,以及一可相对该转动件上下移动的启闭件。该转动件与启闭件各别具有互相对应的一个第一压控部与一个第二压控部。当该启闭件位于一封闭位置时,该启闭件封闭该研磨单元的一研磨空间;而在研磨胡椒时,该转动件的第一压控部转动并带动该第二压控部向下移动,使该启闭件向下移动到一远离该研磨单元的开启位置。借此,当胡椒研磨器不使用时,该启闭件位于该封闭位置,可以避免残留在研磨单元中的胡椒粉末向外掉落。



1. 一种胡椒研磨器,包含:一个界定出一个容装空间的容装单元,以及一个组装在该容装空间的研磨单元,该研磨单元包括一个受带动而转动的连动轴、一个固定设置的外研磨座,以及一个受该连动轴带动而相对该外研磨座转动的内研磨座,该内研磨座与该外研磨座共同界定出一个研磨空间,其特征在于:

该胡椒研磨器还包含一个启闭单元,该启闭单元包括一个与该连动轴连动结合并位于该研磨单元的下方的转动件,以及一个相对该转动件上下移动的启闭件,该转动件具有至少一个朝向该启闭件的第一压控部,该启闭件具有至少一个对应该第一压控部的第二压控部,所述启闭件位于一个封闭位置时,该启闭件邻近该研磨单元并封闭该研磨空间,而该连动轴带动所述内研磨座及转动件转动时,该转动件的第一压控部带动与其对应的第二压控部向下移动,使该启闭件向下移动到一个远离该研磨单元且不封闭该研磨空间的开启位置。

2. 如权利要求1所述的胡椒研磨器,其特征在于:该第一压控部包括一个凹陷设置并且螺旋延伸的凹沟,所述凹沟包括一个位于上方的第一端,以及一个位于下方的第二端,该第二压控部包括一个朝该凹沟突入的突块,当该启闭件位于该封闭位置时,该突块位于该凹沟的第一端,当该启闭件位于该开启位置时,该突块位于该凹沟的第二端。

3. 如权利要求1所述的胡椒研磨器,其特征在于:该转动件包括一个基壁,以及一个自该基壁向下延伸的围壁,该基壁具有一个供该连动轴的底段卡插的连动孔,该围壁具有前述第一压控部,该启闭件包括一个位在该外研磨座的下方的第一壁部,以及一个自该第一壁部向下延伸并围绕在该转动件的外围的第二壁部,前述第二压控部是设置在该第二壁部的内表面。

4. 如权利要求3所述的胡椒研磨器,其特征在于:该围壁具有二个设置在其外表面的第一压控部,以及二个彼此间隔且铅直延伸的复位沟,所述第一压控部都包括一个凹陷设置并且螺旋延伸的凹沟,该凹沟包括一个位于上方的第一端,以及一个位于下方的第二端,所述复位沟都连接其中一个凹沟的第一端以及另一个凹沟的第二端,该启闭件包括二个设置在该第二壁部的内表面的第二压控部,所述第二压控部都包括一个各别朝所述凹沟突入的突块。

5. 如权利要求1所述的胡椒研磨器,其特征在于:该启闭单元还包括一个设置在该启闭件的下方的固定件,以及一个位于该启闭件与该固定件间并提供该启闭件一个恒往该封闭位置移动的弹性复位力的弹性件,该弹性件包括一个与该启闭件连结的第一连接段,以及一个与该固定件连结的第二连接段。

6. 如权利要求5所述的胡椒研磨器,其特征在于:该固定件包括一个固定连接在该弹性件的第二连接段的下方的板部,以及一个自该板部向上突出的轴部,该板部包括一个贯穿设置的贯孔,而该弹性件围绕在该启闭件与该轴部的外围。

胡椒研磨器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种研磨器,特别是涉及一种将胡椒、盐粒等粗粒状调味品研磨成微小粉末状的胡椒研磨器。

背景技术

[0002] 在现代人的饮食习惯中,常使用调味品来添加食物菜肴的美味,例如胡椒就是一种常用的调味品,使用时是将粗粒状的胡椒放置在一个胡椒研磨器中,并借由该胡椒研磨器的一个位于底部的研磨装置来研磨,所述研磨装置通常包括:一个固定设置的外研磨座,以及一个可相对该外研磨座转动的内研磨座,该些内、外研磨座共同界定出一个位于下方的环形开口,当内研磨座相对该外研磨座转动时,胡椒颗粒受该些研磨座的研磨作用而磨成胡椒粉末,并由该环形开口掉出而洒落在食物上。

[0003] 虽然以往胡椒研磨器可以达到研磨功效,然而在研磨使用后,会有部份已被研磨过的胡椒粉末残留在研磨装置中而没有完全洒落到食物上,该些残留的胡椒粉末非常容易从环形开口落下,因此当胡椒研磨器使用完毕而摆放在桌面、橱柜……等处时,将会有胡椒粉末掉落于桌面或柜子表面,进而弄脏该些供胡椒研磨器置放的器具表面。上述胡椒研磨器在使用上不尽理想,有待改良。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是在提供一种具有遮挡功能以避免残留的胡椒粉末向下掉落的胡椒研磨器。

[0005] 本实用新型的目的及解决其技术问题是采用以下的技术方案来实现的。依据本实用新型提出的一种胡椒研磨器,包含:一个界定出一个容装空间的容装单元,以及一个组装在该容装空间的研磨单元,该研磨单元包括一个可受带动而转动的连动轴、一个固定设置的外研磨座,以及一个可受该连动轴带动而相对该外研磨座转动的内研磨座,该内研磨座与该外研磨座共同界定出一个研磨空间,其中,该胡椒研磨器还包含一个启闭单元,该启闭单元包括一个与该连动轴连动结合并位于该研磨单元的下方的转动件,以及一个相对该转动件上下移动的启闭件,该转动件具有至少一个朝向该启闭件的第一压控部,该启闭件具有至少一个对应该第一压控部的第二压控部,所述启闭件位于一个封闭位置时,该启闭件邻近该研磨单元并封闭该研磨空间,而该连动轴带动所述内研磨座及转动件转动时,该转动件的第一压控部带动与其对应的第二压控部向下移动,使该启闭件向下移动到一个远离该研磨单元且不封闭该研磨空间的开启位置。

[0006] 本实用新型的目的以及解决其技术问题还可以采用以下的技术措施来进一步实现。

[0007] 较佳地,前述的胡椒研磨器,其中该第一压控部包括一个凹陷设置并且螺旋延伸的凹沟,所述凹沟包括一个位于上方的第一端,以及一个位于下方的第二端,该第二压控部包括一个朝该凹沟突入的突块,当该启闭件位于该封闭位置时,该突块位于该凹沟的第一

端,当该启闭件位于该开启位置时,该突块位于该凹沟的第二端。

[0008] 较佳地,前述的胡椒研磨器,其中该转动件包括一个基壁,以及一个自该基壁向下延伸的围壁,该基壁具有一个供该连动轴的底段卡插的连动孔,该围壁具有前述第一压控部,该启闭件包括一个位在该外研磨座的下方的第一壁部,以及一个自该第一壁部向下延伸并围绕在该转动件的外围的第二壁部,前述第二压控部是设置在该第二壁部的内表面。

[0009] 较佳地,前述的胡椒研磨器,其中该围壁具有二个设置在其外表面的第一压控部,以及二个彼此间隔且铅直延伸的复位沟,所述第一压控部都包括一个凹陷设置并且螺旋延伸的凹沟,该凹沟包括一个位于上方的第一端,以及一个位于下方的第二端,所述复位沟都连接其中一个凹沟的第一端以及另一个凹沟的第二端,该启闭件包括二个设置在该第二壁部的内表面的第二压控部,所述第二压控部都包括一个各别朝所述凹沟突入的突块。

[0010] 较佳地,前述的胡椒研磨器,其中该启闭单元还包括一个设置在该启闭件的下方的固定件,以及一个位于该启闭件与该固定件间并提供该启闭件一个恒往该封闭位置移动的弹性复位力的弹性件,该弹性件包括一个与该启闭件连结的第一连接段,以及一个与该固定件连结的第二连接段。

[0011] 较佳地,前述的胡椒研磨器,其中该固定件包括一个固定连接在该弹性件的第二连接段的下方的板部,以及一个自该板部向上突出的轴部,该板部包括一个贯穿设置的贯孔,而该弹性件围绕在该启闭件与该轴部的外围。

[0012] 本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。借由上述技术方案,本实用新型胡椒研磨器至少具有下列优点及有益效果:当该胡椒研磨器不使用时,该启闭单元位于该封闭位置以封闭该研磨空间,使残留在研磨单元中的胡椒粉无法向外落出,借由启闭单元的挡止作用可避免本实用新型摆置于桌面时将桌面弄脏。

[0013] 综上所述,本实用新型是有关于一种胡椒研磨器,包含:一容装单元、一研磨单元,以及一启闭单元。该启闭单元包括一个可转动地设置的转动件,以及一可相对该转动件上下移动的启闭件。该转动件与启闭件各别具有互相对应的一个第一压控部与一个第二压控部。当该启闭件位于一封闭位置时,该启闭件封闭该研磨单元的一研磨空间;而在研磨胡椒时,该转动件的第一压控部转动并带动该第二压控部向下移动,使该启闭件向下移动到一远离该研磨单元的开启位置。借此,当胡椒研磨器不使用时,该启闭件位于该封闭位置,可以避免残留在研磨单元中的胡椒粉向外掉落。本实用新型在技术上有显著的进步,并具有明显的积极效果,诚为一新颖、进步、实用的新设计。

[0014] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型胡椒研磨器的一最佳实施例的组合剖视图,同时显示一启闭单元位于一封闭位置。

[0016] 图2是该最佳实施例的部分元件的分解立体图。

[0017] 图3是图1的局部放大图。

[0018] 图4是一局部剖视图,显示该启闭单元位于一开启位置。

具体实施方式

[0019] 为更进一步阐述本实用新型为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型提出的胡椒研磨器其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。

[0020] 请参阅图 1、图 2、图 3 所示,分别是本实用新型胡椒研磨器的一最佳实施例的组合剖视图,该最佳实施例的部分元件的分解立体图,及图 1 的局部放大图。本实用新型最佳实施例的胡椒研磨器的包含:一容装单元 1、一研磨单元 2,以及一启闭单元 3。

[0021] 该容装单元 1 包括一中空的瓶体 11,以及一个可相对转动地安装在该瓶体 11 的顶部的盖体 12,该盖体 12 与该瓶体 11 共同界定出一供胡椒粒摆放的容装空间 10。

[0022] 该研磨单元 2 组装在该容装空间 10 的下半部,并包括:一个上下直立延伸且截面呈方形的连动轴 21、一个固定设置的外研磨座 22,以及一个可相对转动地位于该外研磨座 22 的内部的内研磨座 23。该连动轴 21 的顶段与该盖体 12 连动结合,其底段与该内研磨座 23 连动结合并向下穿过该内研磨座 23,该连动轴 21 可受该盖体 12 带动而相对该瓶体 11 转动,进而带动该内研磨座 23 相对该外研磨座 22 转动而研磨胡椒。该内研磨座 23 与该外研磨座 22 共同界定出一个环绕设置的研磨空间 20,研磨后的胡椒粉可通过该研磨空间 20 向下洒落。

[0023] 该启闭单元 3 包括:一个转动件 31、一个启闭件 32、一固定件 33,以及一弹性件 34。

[0024] 其中,该转动件 31 位于该些内研磨座 23 与外研磨座 22 的下方,并连结该连动轴 21 的底段且可受该连动轴 21 带动而同步转动。该转动件 31 包括一个外周呈圆形的基壁 311,以及一个自该基壁 311 向下延伸的中空的围壁 312。该基壁 311 具有一个呈方形并供该连动轴 21 的底段卡插的连动孔 313。该围壁 312 包括三个等角度间隔地设在其外表面的第一压控部 314,以及三个连接在两两相邻的第一压控部 314 间的复位沟 315。

[0025] 该些所述第一压控部 314 都包括一凹设在围壁 312 的外表面的凹沟 316,所述凹沟 316 都是沿着一中心轴线而螺旋状延伸,并且都包括一个位于上方的第一端 317,以及一个位于下方的第二端 318,该些第一端 317 与第二端 318 位于不同的铅直线上。所述复位沟 315 都是铅直延伸并且彼此等角度间隔设置,所述复位沟 315 的顶端连接位于其右侧的凹沟 316 的第一端 317,复位沟 315 的底端连结位于其左侧的凹沟 316 的第二端 318。

[0026] 该启闭件 32 围绕在该转动件 31 的外周并可相对该转动件 31 上下移动,该启闭件 32 包括:一个环形并位在该些所述内、外研磨座 23、22 的下方的第一壁部 321、一自该第一壁部 321 向下延伸并围绕在该转动件 31 的外围的第二壁部 322,以及三个等角度间隔地设置在该第二壁部 322 的内表面的第二压控部 323(图 2 只示出 2 个)。其中,该第一壁部 321 的外径长度大于该第二壁部 322 的外径长度,该第二壁部 322 的外表面呈阶梯状。该些第二压控部 323 都包括一个自该第二壁部 322 的内表面朝该转动件 31 的凹沟 316 突出的突块 324。

[0027] 该固定件 33 位于该转动件 31 的下方,并包括一个固定设置于该瓶体 11 的底部的圆形的板部 331,以及一个自该板部 331 的中央向上突出的轴部 332。前述板部 331 包括数个等角度间隔并贯穿其顶、底面的贯孔 333。

[0028] 该弹性件 34 环套在该些启闭件 32 的第二壁部 322, 以及该固定件 33 的轴部 332 的外周, 而且是被抵压于该第二壁部 322 与该固定件 33 的板部 331 之间, 该弹性件 34 包括一个与该第二壁部 322 连结的第一连接段 341, 以及一个与该板部 331 连结的第二连接段 342。

[0029] 请参阅图 1、图 3、图 4 所示, 图 3 是图 1 的局部放大图; 图 4 是一局部剖视图, 显示该启闭单元位于一开启位置。本实用新型可在一个如图 1、图 3 所示的封闭位置, 以及一个如图 4 所示的开启位置间移动。当本实用新型尚未使用并位于该封闭位置时, 该启闭件 32 抵压在该研磨单元 2 的下方并封闭该研磨空间 20 的下方开口, 使胡椒粉无法洒出。而且此时该启闭件 32 的突块 324 位于转动件 31 的凹沟 316 的第一端 317。

[0030] 使用时, 转动该盖体 12 可带动该连动轴 21、内研磨座 23 转动而研磨胡椒, 该连动轴 21 转动的同时也带动该转动件 31 转动, 由于转动件 31 的凹沟 316 与启闭件 32 的突块 324 相卡合, 该些突块 324 必须顺着凹沟 316 转动时的螺旋延伸方向而移动, 自然地产生使该启闭件 32 向下移动的力量, 该胡椒研磨器因而转换到图 4 的开启位置, 此时该启闭件 32 远离该研磨单元 2 而不再封闭该研磨空间 20 的下方开口, 被研磨的胡椒粉可以由该研磨空间 20 洒出, 并往下经由该固定件 33 的该些贯孔 333 而向外洒落。

[0031] 请参阅图 2、图 3、图 4 所示, 当该启闭件 32 位于该开启位置时, 该启闭件 32 向下抵压该弹性件 34, 使该弹性件 34 被压缩而蓄积一个恒将该启闭件 32 朝上推动的弹性复位力。由于在开启位置时, 该启闭件 32 的该些突块 324 位于所述凹沟 316 的第二端 318, 而且第二端 318 向上连结铅直的复位沟 315, 因此当解除施于该盖体 12 的转动力量时, 启闭件 32 将被弹性件 34 的弹性复位力直接往上顶推, 使突块 324 沿着复位沟 315 而铅直向上, 最后移动到复位沟 315 的顶部与凹沟的第一端 317 的连接处, 该启闭件 32 就再度回到该封闭位置。

[0032] 需要说明的是, 该些第一压控部 314 与第二压控部 323 可以交换设计, 也就是将该些突块 324 设置在该转动件 31 的外表面, 将该些凹沟 316 设置在该启闭件 32 的内表面, 如此也可以借由凹沟与突块的卡合作用而推动该启闭件 32 向下移动。而且第一压控部 314 与第二压控部 323 都设置一个时, 也可以带动该启闭件 32 往下移动。

[0033] 综上所述, 借由设置该启闭单元 3, 当研磨使用时, 该启闭件 32 移动到该开启位置而不会封闭该研磨空间 20, 使胡椒粉可以向外洒出, 当使用完毕后, 该启闭件 32 复位到该封闭位置以封闭该研磨空间 20 的下方开口, 使残留在研磨单元 2 中的胡椒粉无法向外洒出, 因此本实用新型摆置于桌面时, 不会弄脏桌面, 确实达到本实用新型的目的。

[0034] 以上所述, 仅是本实用新型的较佳实施例而已, 并非对本实用新型作任何形式上的限制, 虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上, 然而并非用以限定本实用新型, 任何熟悉本专业的技术人员在不脱离本实用新型技术方案范围内, 当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例, 但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容, 依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰, 均仍属于本实用新型技术方案的范围。

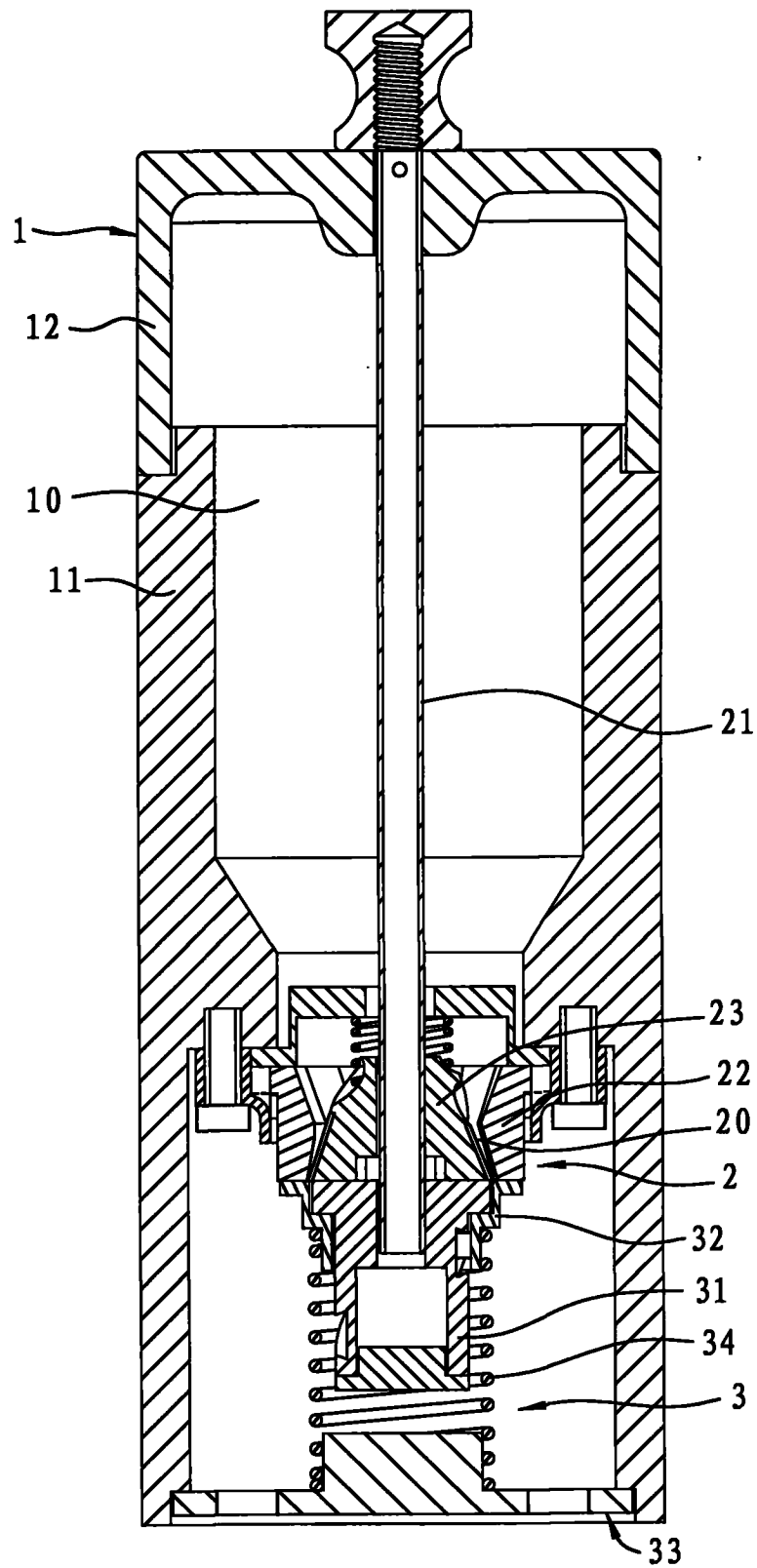


图 1

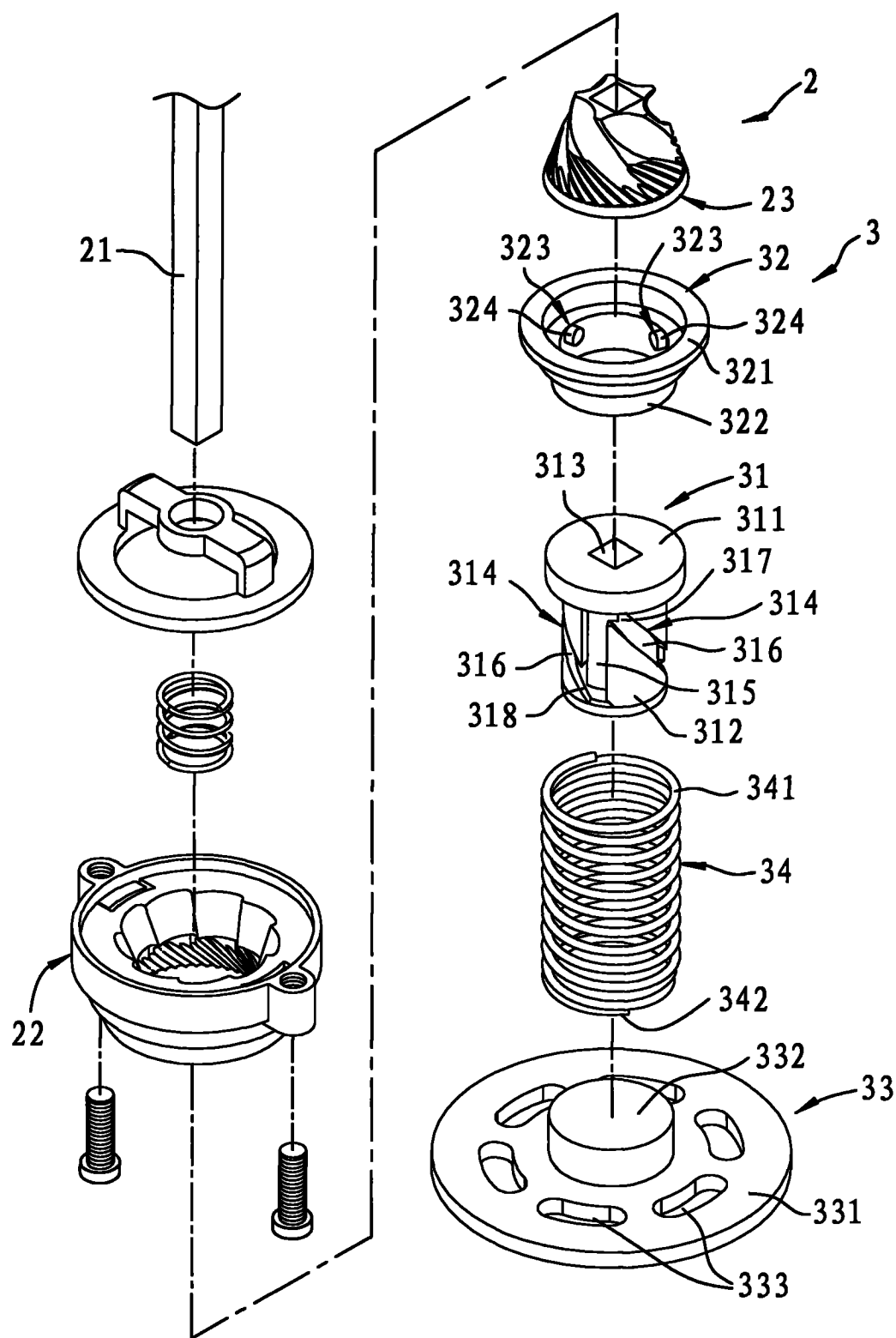


图 2

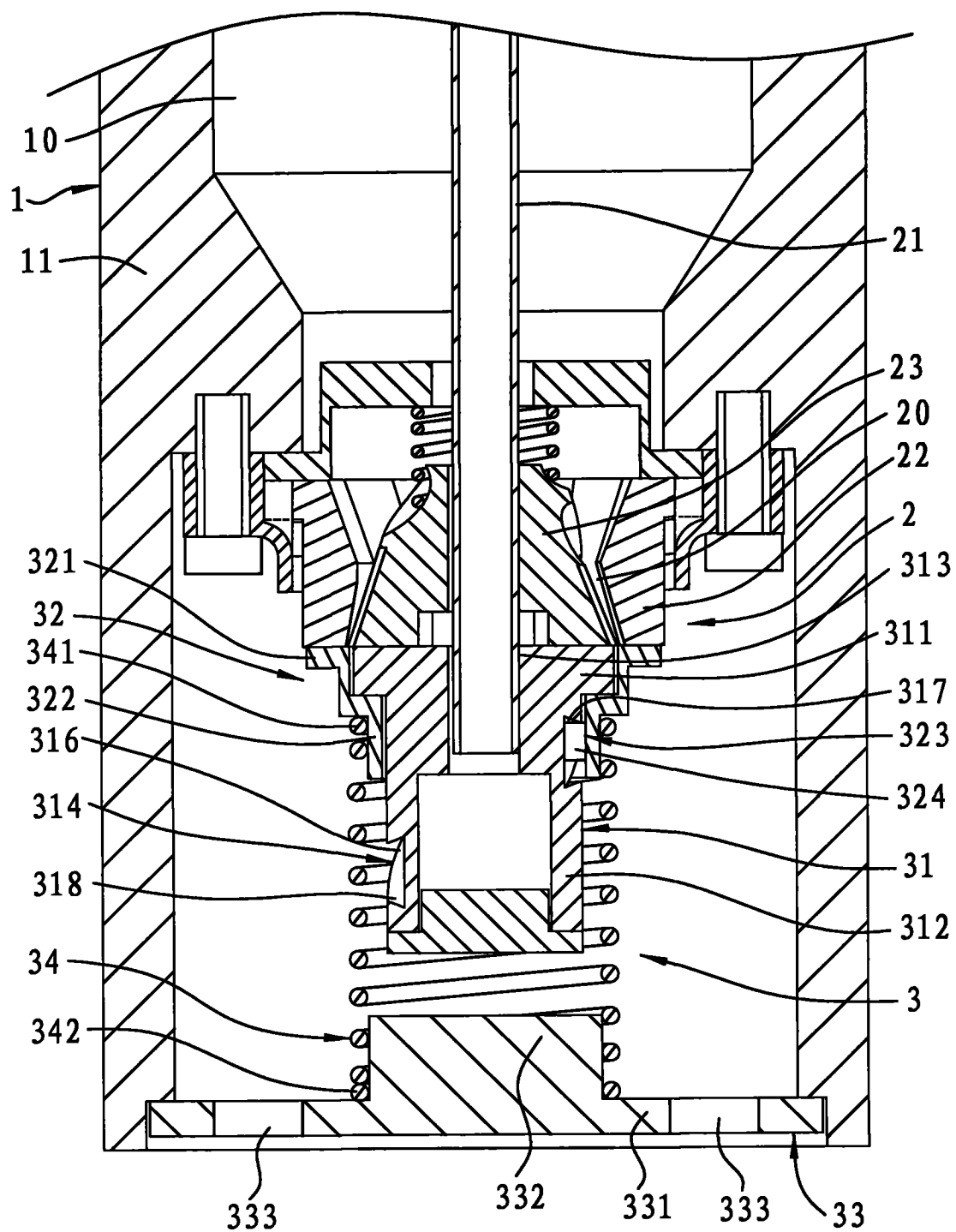


图 3

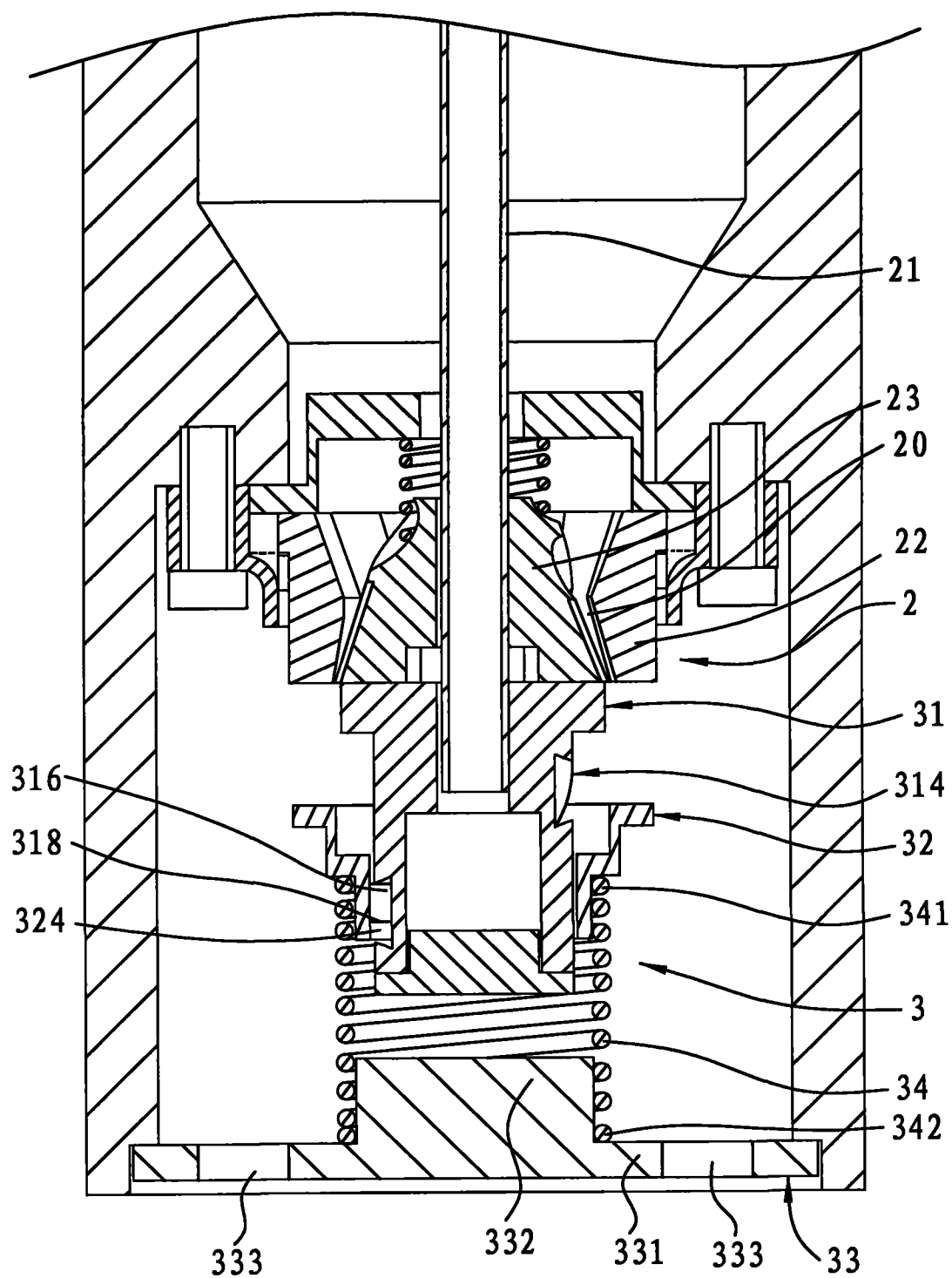


图 4